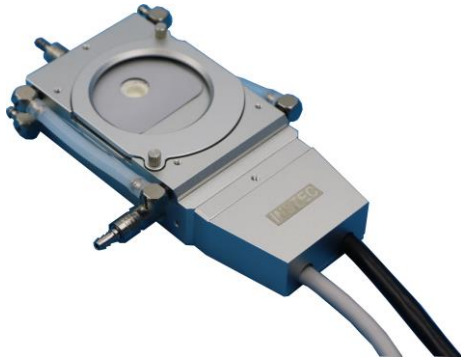


HS1500G

1500°C高温 气密腔

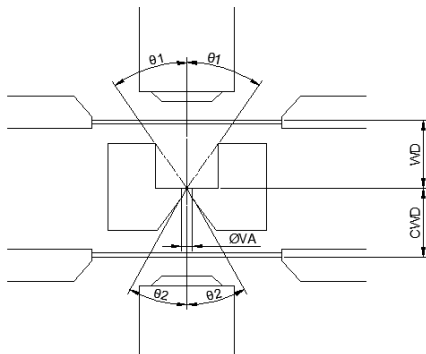
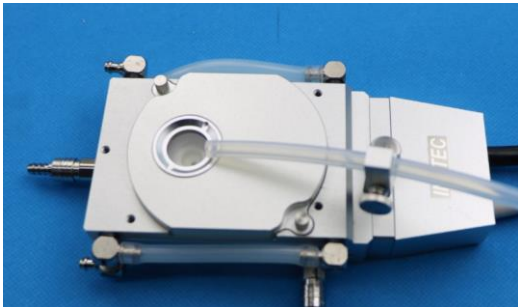


功能特点

- 适用于 显微镜/光谱仪 的超高温应用
- 30°C~1200°C 可编程控温
- Φ8 mm 加热区
- 样品区-视窗 偏心设计, 可旋转窗片移开高温挥发物
- 可充入保护气体的气密腔
- 可从温控器或电脑软件控制, 可提供软件 SDK
- *可做定制或改动, 详询上海恒商

增高盖

- 适用于 红外设备 的超高温应用
- 增加加热区与红外玻璃距离, 防止损坏



产品简介

HS1500G 高温热台专为显微镜/光谱仪上的超高温应用设计, 可用于陶瓷、冶金、地质、高温材料等领域。可加装样品接电引线, 可定制样品区。

此款冷热台可在 30°C ~ 1500°C 范围内控温, 同时允许光学观察和样品气体环境控制。热台窗盖与台体构成一个气密腔, 且样品区偏离视窗中心, 这样即可以充入氮气等保护气体, 来防止样品高温下反应, 又可以通过旋转窗片来移开窗片上的挥发物。

温控参数

温度范围	30°C ~ 1500°C
加热块材质	耐高温陶瓷
传感器/温控方式	S 型热电偶 / PID 控制
最大加热/制冷速度	+200°C/min (<850°C时); +20°C/min (>850°C时)
最小加热/制冷速度	±0.5°C/min
温度分辨率	0.1°C
温度稳定性	±1°C
软件功能	可设温控速率, 可设温控程序, 可记录温控曲线

光学参数

适用光路	透射光路 和 反射光路
窗片	可拆卸与更替的窗片
最小物镜工作距离	6.3 mm (标准) 11.7 mm (增高盖) *截面图中 WD
最小聚光镜工作距离	11.75 mm *截面图中 CWD
透光孔	Φ2 mm *截面图中ΦVA
上盖窗片观察	窗片范围 Φ28mm, 最大视角±45°(标准) 窗片范围 Φ16mm, 最大视角±34°(增高盖) *截面图中θ1
底部窗片观察	最大视角±21.6° *截面图中θ2
高温下显微镜降温	吹气降温

结构参数

加热区/样品区	Φ8 mm
样品腔高	3.5 mm
	*样品最大厚度 = 样品腔高 - 样品衬底厚度
样品衬底	默认为石英坩埚 (Φ6 mmx1 mm)
上盖	可调压力的窗盖, 兼顾气密型与窗片旋转
气氛控制	气密腔, 可充入保护气体
外壳冷却	通循环水, 以维持外壳温度在常温附近
安装方式	水平安装 或 垂直安装
台体尺寸/重量	141 mm x 62 mm x 25.3 mm / 1350g

配置列表

基本配置	HS1500G 高温热台、mK2000B 温控器、外壳循环水冷却系统
可选配件	冷热台安装支架、真空系统 (仅用于真空型号)、样品接电引线

温控配件系列

用于 Instec 温控装置

适用范围

用于搭配 Instec 冷热台、Instec 温控探针台、Instec 温控晶圆夹盘、Instec 冷热平板、Instec 定制温控装置使用。

温控配件系列

安装支架：用于将温控装置固定在用户设备上
mK2000B 温控器，含 InstecAPP 温控软件，温控装置必选
外壳循环水冷系统，帕尔贴式温控装置必选
MITO 系列温控联用显微镜相机，含控制软件
LWDC2 长工作距离聚光镜
真空系统：包括真空泵+真空管路，用于真空型温控装置

外壳循环水冷系统

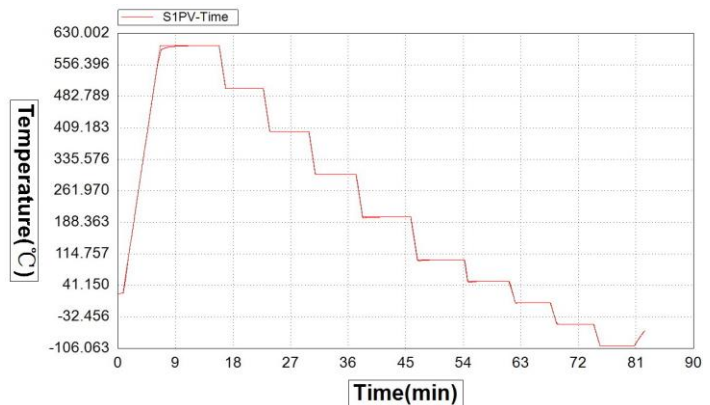
用于温控装置的外壳/底座的冷却。温控装置加热/制冷时，外壳/底座温度会被带得很烫/很凉，危害周遭人员设备甚至设备自身。用循环水让外壳温度保持在常温附近，能有效预防此灾害。



mK2000B 温控器

支持恒温、恒速率变温、暂停、编程温控功能。具有冷热独立的多段 PID 控制、可保存 4 套 20 段校准表等特点。可独立控制，也可从 InstecAPP 软件控制。

温度分辨率	±0.001°C (热敏电阻), ±0.01°C (RTD), ±0.1°C (热电偶)
控制接口	USB 虚拟串口 可选其他接口
可选项	LVDC 线性可调直流电源, 用于降低电噪音
温控软件	InstecAPP, 可提供多语言 SDK



安装支架

针对用户设备定制，可让热台水平固定/垂直固定等，垂直光路/水平光路等的用户设备皆可适用。通常有：

- 圆环式（用于圆形载物台）、平板式（用于方形载物台）、
- 载物台式（用于代替设备载物台）、立式（用于水平光路）。

